

Перечень публикаций официального оппонента
Григорьева Федора Васильевича,
соответствующих специальности 1.2.2

1. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. High-performance Full-atomistic Simulation of Optical Thin Films // *Supercomputing Frontiers and Innovations*. 2018. Vol. 5, Issue 3. Pp. 130-133.
2. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Zhang J., Cheng X., Wang Z., Tikhonravov A.V. Influence of Small-Size Contaminations on Thin Film Structural Properties // *Chinese Physics Letters*. 2019. Vol. 36, Issue 3. P. 038101.
3. Григорьев Ф.В., Сулимов В.Б., Тихонравов А.В. Зависимость пористости тонких пленок от условий напыления: результаты молекулярно-динамического моделирования // *Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия*. 2019. №. 2. С. 69-72.
4. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Structure of highly porous silicon dioxide thin film: Results of atomistic simulation // *Coatings*. 2019. Vol. 9, Issue 9. P. 568.
5. Григорьев Ф.В., Сулимов В.Б., Тихонравов А.В. Молекулярно-динамическое моделирование напыления тонких пленок, состоящих из слоев с чередующейся плотностью // *Журнал физической химии*. 2020. Т. 94, №. 5. С. 754-759.
6. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Stress distribution in highly porous SiO₂ films: results of the molecular dynamics simulation // *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. – IOP Publishing. 2020. Vol. 904, Issue 1. P. 012004.
7. Sulimov A.V., Kutov D.C., Grigoriev F.V., Tikhonravov A.V., Sulimov V.B. Generation of Amorphous Silicon Dioxide Structures via Melting-Quenching Density Functional Modeling // *Lobachevskii Journal of Mathematics*. 2020. Vol. 41, Issue 8. Pp. 1581-1590.
8. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Combined modeling of the optical anisotropy of porous thin films // *Coatings*. 2020. Vol. 10, Issue 6. P. 517.
9. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Atomistic simulation of stresses in growing silicon dioxide films // *Coatings*. 2020. Vol. 10, Issue 3. P. 220.
10. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Structure and properties of the low-energy deposited TiO₂ thin films: results of the molecular dynamics simulation // *Journal of Physics: Conference Series*. – IOP Publishing. 2021. Vol. 2015, Issue 1. P. 012051.
11. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Molecular Dynamics Simulation of Laser Induced Heating of Silicon Dioxide Thin Films // *Nanomaterials*. 2021. Vol. 11, Issue 11. P. 2986.

12. Grigoriev F.V., Zhupanov V.P., Chesnokov D.A., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Molecular Dynamics Simulation of Heat Transfer and Stresses in Thin Films Caused by a Short Laser Pulse // Lobachevskii Journal of Mathematics. 2021. Vol. 42, Issue 7. Pp. 1514-1520.

13. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Laser-Induced Thermal Stresses in Dense and Porous Silicon Dioxide Films // Coatings. 2021. Vol. 11, Issue 4. P. 394.

14. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Anisotropy of glancing angle deposited films: results of atomistic simulation // Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publishing. 2021. Vol. 1730, Issue 1. P. 012032.

15. Grigoriev F.V., Sulimov V.B., Tikhonravov A.V. Application of a large-scale molecular dynamics approach to modelling the deposition of TiO₂ thin films // Computational Materials Science. 2021. Vol. 188. P. 110202.


(подпись оппонента)

/ Григорьев Ф.В.
(расшифровка подписи)

20.05.2022